

Références bibliographiques

- [1] *N. BENMOUSSA, " Conception, modélisation et réalisation d'un capteur de pression capacitif Microélectronique ", Thèse doctorat de l'université Paris Sabatier Toulouse, 1985.*
- [2] *F. KERROUR, "Etude et Modélisation de Capteur de Pression Piézorésistifs et Capacitifs au Silicium ", Thèse Doctorat, Université Mentouri Constantine, 2008.*
- [3] *P MENINI, " Faisabilité d'un capteur de pression capacitif miniature sur silicium", Thèse doctorat Université Paris Sabatier Toulouse. 1998*
- [4] *Y. LEE, K. WISE "A batch- fabricated silicon capacitive pressure transducer with low temperature sensitivity ", IEEE transaction on electronics devisees, Vol. ED-29.*
- [5] *F. OLIVIER, "Capteurs et électronique associée",2000.*
- [6] *G. ASCH et collaborateurs, "les capteurs en instrumentation industrielle", Bordas, Paris, ISBN s2-04-016948-2, 1987.*
- [7] *F. KERROUR, "Etude et Modélisation de Capteur de Pression Piézorésistif et Capacitifs au Silicium ", Thèse Doctorat, Université Mentouri Constantine, 2008.*
- [8] *P. MENINI, "Faisabilité d'un capteur de pression capacitif miniature sur silicium", Thèse doctorat, Université Paris Sabatier Toulouse, 1998.*
- [9] *A. BOUGHAROUAT, "Modification de la sensibilité d'un QCM (Quartz Cristal Microbalance) par le dépôt dessus de films minces élaborés par plasma à partir de vapeurs de TEOS", mémoire de magister en Microélectronique, Université de Constantine, Avril 2009.*
- [10] *N. NORBERT, "du signal à l'information : le capteur intelligent exemples industriels en médecine", S.L : Habilitation à diriger des recherches, Avril 2002.*
- [11] *D. MARI, "Transducteurs et capteurs I", Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, Novembre 2011.*
- [12] *M .RAS LAIN, " Contribution à l'identification des paramètres de non idéalité dans les capteurs de pression piézorésistifs au Silicium", Diplôme de Doctorat en Sciences, l'université de Constantine, 06/07/2009.*

- [13] C. DOMINGUES, "Conception de transducteurs acoustiques micro-usinés", *Thèse Doctorat en Micro et Nano Electronique, Ecole Doctorale TIMA, 29 avril 2005.*
- [14] I. BENACER, "Modélisation comportementale de SPICE a VHDL-AMS" *mémoire de magister, Université de Batna.*
- [15] S. BELKACEM, "Macromodélisation comportementale de circuits analogiques application au circuit convoyeur de courant", *mémoire de magister en micro-électronique, Université de Batna, 2005.*
- [16] F. LEMERY, "Modélisation comportementale des circuits analogiques et mixtes", *thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Grenoble, décembre 1995.*
- [17] D. ANDREU, "La Modélisation Comportementale de SPICE a VHDL-AMS", *Enseeiht, Département d'électronique, Toulouse.*
- [18] K. MERABET, " Etude et simulation d'un capteur de pression capacitif au silicium", *mémoire de magister en électronique, Université de Constantine, 2010.*
- [19] A. BOUBAAYA ET A. BOURAS, "Simulation de composants électronique par PSpice ", *mémoire d'ingénieur d'état en génie électronique, Université de M'Sila, 2010.*
- [20] S. JEMMALI, " Contribution à l'élaboration de méthodologies et d'outils d'aide à la conception de système multi technologiques", *thèse de doctorat, Ecole Nationale Supérieure des Communications, 2003.*
- [21] C.S. SMITH, "Piézorésistance Effect in Germanium and Silicon", *Phys. Rev. 94, (1954).*
- [22] W. YANG " Conception et intégration de microsystèmes sur un cylindre pour la mesure de ses déformations : application à un outil du domaine de la santé ", *thèse doctorat, l'université de Grenoble, Novembre 2011.*
- [23] J.T. BEEK, P.G. STEENEKEN, and B. GIESBERS "A 10MHz piezoresistive MEMS resonator with high Q ", *In International Frequency Contrat Symposium and Exposition, IEEE 2006.*

- [24] *A.BARLIAN et al., Review "Semiconductor Piezoresistance for Microsystems", Proceedings of the IEEE , vol.97, no.3, pp.513-552, 2009*
- [25] *P.J. FRENCH, A.G.R. EVANS," Piezoresistance in polysilicon and its applications to strain gauges", Solid-State Electronics, Volume 32, Issue 1, January 1989.*
- [26] *Y.KANDA "A graphical representation of the piezoresistance coefficients in Silicon", IEEE Trans, On Electron Devices, Vol.29, N°1, Jan 1982.*
- [27] *P. POULICHET, "conditionnement du signal du capteur",*